萌芽的研究支援課題 報告書

氏名(フリガナ): 新井邦明(アライクニアキ)所属機関: 東京大学大学院学年: 博士課程2年課題番号: 2008A1723利用ビームライン: BL17SU課題名: NiO(100)における磁気的に安定な反強磁性磁区構造の解明研究成果番号:

<u>研究背景</u>

近年、反強磁性層と強磁性層の界面で生じる交換バイアスは、ハードディスクの読み取りヘッ ド等の磁気記録デバイスに利用されている。交換バイアスのメカニズムの解明は、磁気記録デバ イスの更なる特性の向上に不可欠である。交換バイアスの大きさは、反強磁性スピン構造、反強 磁性磁壁構造などに依存するため、反強磁性磁区構造について研究がなされてきた。磁気線二色 性(MLD)は、反強磁性スピン軸方向を直接観測できることと、近年の放射光光源の発達や理 論研究の進展により、MLD を用いた反強磁性磁気構造の研究が盛んに行われている。特に、典 型的な反強磁性体である NiO は、ネール温度が室温よりも高く、比較的単純な結晶構造を持つ ことから、昔から研究がなされている。これまで、D. Alders らによって、Ni L, 吸収端における 2つの吸収ピーク比が 3cos²0-1 (0は偏光ベクトルとスピン軸のなす角度)に比例することが示 された[1]。また、F.U.Hillebrecht らにより、光電子顕微鏡(PEEM)を用いた局所領域 MLD に より、上記の報告が正しいことが示された[2,3]。しかし、近年、E. Arenholz らにより、NiO(001) において水平偏光ベクトル方向が[001]のときは、上記の報告と結果が一致するが、[011]のとき は、異なる結果を示すという報告がなされた[4]。したがって、NiO の MLD について統一的な理 解が得られていない。NiO のスピン容易軸は全部で 12 種類存在し、スピンによるドメイン(S ドメイン)だけでなく結晶歪によるドメイン(Tドメイン)も存在するため、磁区構造は複雑で ある。上記のこれまでの報告では、S ドメインのみの情報しか得られておらず、MLD のみによ る詳細なSドメインのアサインは困難である[2,3]。また、NiO(001)表面上にCo薄膜をのせた系 において磁場印加中の MLD 測定をしているので、バルクの NiO のスピン情報を直接観測してい るとは言い難い[4]。そのため、TとSドメイン両方の情報を直接観測し、Sドメインの局所領 域 MLD を取得する必要がある。これまでの報告では、1 つの T ドメイン内の 1 種類の S ドメイ ン(シングル S ドメイン)の MLD しか観測されていない[2,3]。T ドメイン内には 3 種類の S ド メインが存在しうるので、4 種類の T ドメインと、1 つの T ドメイン内に 3 種類の S ドメイン が存在しうる領域で、局所領域 LD と MLD を取得した方が、よりスピン軸方向と MLD の関係お よび軌道の異方性と結晶歪方向(Tドメイン)の関係を明らかにできる。

一方、反強磁性磁区構造に関しては、MLD と PEEM を用いた手法により、その詳細が明らか になりつつある。しかしながら、上述したように、NiO の磁区構造は複雑であるため、磁壁構造 などほとんど分かっていない。磁区構造の理解には、磁壁構造のメカニズムの理解が必要である。 これまでの我々による実験結果により、NiOをネール温度以上に加熱すると、{011}T-wallが減少し、 {001}T-wall が増加することが分かった。これは、{011}T-wall よりも{001}T-wall エネルギーが小さ いことを示唆する結果である。この T-wall エネルギーの差異は、結晶方位に依存する交換エネル ギーの差異によることが理論的に示唆されており[5]、実験的には未だに明らかにされていない。

<u>実験目的</u>

本課題では、PEEM を用いて NiO(100)の局所領域 O K 吸収端における線二色性(LD)[6]、Ni L2 吸収端における MLD を取得することにより、T とSドメインを直接観測し、MLD とスピン軸の関係、O 2p 軌道の異方性による LD と Ni スピンによる MLD の関係、結晶方位に依存する T-wall エネルギーの差異の原因を明らかにすることである。これにより、T とSドメインの完全なアサインを行い、この系の磁区構造についての知見を深める。

実験方法

実験は、BL17SUのPEEMを用いて行った。試料は、へき開されたNiO(100)を用いた。結晶方 位と表面構造を確認するため、低エネルギー電子回折(LEED)を用いて確認した。次に、直線偏光 と垂直偏光による、OK吸収端におけるLDとNiL2吸収端におけるMLDを用いて、4種類のT ドメインとTドメイン内に3種類のSドメインが存在する領域を探し出し、Tドメイン内のLD とSドメイン内のMLDの面内角度依存性を取得し、スピンとMLDの関係、O2p軌道の異方性 によるLDとMLDの関係を調べた。また、局所領域MLDの面内角度依存性から、T-wall内のスピ ン構造を直接観察した[7]。

実験結果と考察

図1に Ni L2 吸収端(a)と O K 吸収端(b)における吸収スペクトルを示す。 図1(a)の2つのピーク (869.25 & 870.52eV)で強い MLD が現れることを確認した。 また、 図1(b)の O K 吸収端における 吸収ピーク近傍(531.09 & 531.69 eV)で強い LD が現れることを確認した。 これは、 これまでの 我々による実験結果[8]および以前の研究報告[1-3]と一致している。

図2に、水平&垂直偏光による LD と MLD イメージを示す。これらのイメージは、図1に示した O K 吸収端と Ni L2 吸収端の2つの photon energy で取得したイメージを割り算(高エネルギー/低エ ネルギー)することにより得た。これにより磁気コントラストを強め、光の強度ムラ等によるバックグラ ウンドを低減できる。LD は、O 2p 軌道の異方性による二色性であり、結晶歪方向を反映している ので、LD イメージは Tドメイン構造を示している。また、MLD はスピン軸の情報を反映しているので、 MLD イメージは Sドメイン構造を示している。試料を面内回転したときの LD と MLD コントラストの 変化から、垂直偏光の場合の LD と MLD イメージ(図2(b)&(d))において 4 種類の Tドメイン、1つ のTドメイン内に3種類のSドメインが存在することが分かった。また、図2(b)のLDイメージから、 T-wall が<001>&<011>方向に走っており、図2(d)のMLDイメージでは、1つのTドメイン内に3 種類のSドメインが存在していることから、バルクの磁区構造を反映していると考えられる。

図3に水平偏光(a)と垂直偏光(b)を用いた際のNiL2 吸収端の吸収ピーク比を示した。MLDを 取得した領域は、図2(d)に示されている色線で囲まれた領域であり、1つのTドメイン内の3種類 のSドメインである。吸収ピーク比は、3種類のSドメイン内の図1(a)の2つの吸収ピーク比である。 図3を見ると、観測された結晶方位に対するMLDの変化は、sin 関数でfittingでき、スピン軸方向 を反映していると考えられる。分子場を考慮した理論計算と比較したところ、定性的にはよい一致 を示したが、定量的には一致していない。そのため、測定データのバックグラウンド等を除去するな どして、再度、比較する予定である。また、4種類のTドメイン内のLDの結晶方位依存性も取得し たが、バックグラウンドが大きく、sin 関数ではfittingできていないが、O2p軌道の異方性を反映し た、LDコントラストの変化を観測できた。今後、結晶場などの効果を取り入れた理論計算と比較す ることにより、MLDとスピン軸方向の関係、LDと結晶歪方向、O2p軌道の異方性の関係を調べ、 TとSドメインのアサインを行う予定である。

また、水平偏光による Ni L₂吸収端での MLD を用いることにより、{001}と{011}T-wall の 直接観察に成功した。図 4(a)と(c)は、入射水平偏光ベクトルが(a)[001]方向と(c)[01-1]方向 のときの Ni L₂吸収端における MLD を反映したイメージを示している。図 4(b)と(d)は、{001} と{011}T-wall 内の吸収強度の line profile を示している。Line profile をガウス関数で fitting し、{001}と{011}T-wall 幅を見積もった結果、それぞれ 274 nm と 517 nm であった。この 結果は、{001}T-wall のエネルギーが{011}T-wall のそれよりも小さいことを示しており、こ の磁壁エネルギーの差異は、以前の理論による報告で示唆されたように[5]、交換エネルギ ーによる差異であると考えられる。また、試料表面に平行な水平偏光による吸収強度の面 内角度依存性を取得した結果、T-wall が wall 内で試料表面に対して平行なスピン分布(ネ ール磁壁)をもつことが分かった。今後は、これらの T-wall に隣接した S ドメインのスピ ン軸を決定し、上記の磁壁エネルギーの差異の原因を明らかにする。

<u>参考文献</u>

- [1] D.Alders et al., Europhys. Lett. 32, 259(1995).
- [2] F.U.Hillebrecht et al., Phys.Rev.Lett. 86.3419 (2001).
- [3] H.Ohldag et al., Phys.Rev.Lett. 86.2878 (2001).
- [4] E.Arenholz et al., Phys.Rev.Lett. 98, 197201(2007).
- [5] T. Yamada: J.Phys.Soc.Japan 21, 650(1966).
- [6] T.Kinoshita et al., J.Phys.Soc.Jpn. 73(2004)2932.
- [7] N.B.Weber et al., Phys.Rev.Lett. 91,237205(2003).
- [8] K. Arai et al., (to be published).





図1(a) NiO(100)の Ni L2吸収端の吸収スペクトル。



図1(b) OK 吸収端における吸収スペクトル。



図2 水平偏光(a&c)と垂直偏光(b&d)による O K 吸収端の LD(a&b)と Ni L₂ 吸収端の MLD(c&d) を反映したイメージ。(a)と(b)は Tドメイン構造、(c)&(d)は、Sドメイン構造を示している。



図 3(a) 水平偏光を用いた際の Ni L₂ 吸収端における 3 種類の Sドメイン(図 2(d))内の、2つの 吸収ピーク比の結晶方位依存性。点線が測定点、直線が sin 関数で fitting したもの。



図 3(b) 垂直偏光を用いた際の、Ni L₂ 吸収端における 3 種類の Sドメイン(図 2(d))内の、2つ の吸収ピーク比の結晶方位依存性。点線が測定点、直線が sin 関数で fitting したもの。



図4 水平偏光を用いた場合のNiL₂ 吸収端におけるMLDイメージ(a&c)。イメージ内の赤線で囲まれた領域の{001}&{011}T-wall 内の MLD 強度プロファイルを(b)&(d)に示している。ガウス関数で fitting した結果、{001}&{011}T-wall 幅は、274 nm、517 nm である。